

公開番号 又は 特許番号	WO2012-161317、再表 2012-161317
発明名称	微細孔を配した基体の製造方法。及び微細孔を配した基体
出願人 又は 権利者	株式会社フジクラ、国立大学法人東京大学
想定デバイス	バイオ分析チップ、その他
要約	<p>【利用分野】 微細孔を有する基体の製造方法、及び微細孔を有する基体に関するもの。</p> <p>【発明の内容】 孔径がナノオーダーの大きさである微細孔を有する基体の製造方法、および前記基体の提供するものであり、基体の内部において、ピコ秒オーダー以下の時間幅を有する第一レーザー光の焦点を走査することにより、エッチング選択性を有する第一改質部および第二の改質部を形成し、前記第一改質部の第一部分および前記第二改質部第一部分と重なるように、ピコ秒オーダー以下の時間幅を有する第二のレーザー光の焦点を走査することにより、前記第一改質部の前記第一部分の改質状態が変性した第一再改質部および前記第二改質部の前記第一部分の改質状態が変性した第二再改質部を形成し、前記第一再改質部及び前記第二再改質部を加熱することにより、前記第一再改質部及び前記第二再改質部のエッチング耐性を高めて、前記第一再改質部及び前記第二再改質部以外の前記第一改質部及び前記第二改質部をエッチングにより除去して、前記基体内に微細孔を形成することを特徴とする微細孔を有する基体の製造方法。</p>
図面	<p>【図5D】</p> 